# スロットダイの精密スリット幅測定

特開2004-069393, 特開2004-069394, 特開2005-214864 特開2005-214865, 特開2005-214866, 特開2005-221305

### 研究の背景・目的

・スロットダイ(塗布工具)の性能向上のために、先端スリット幅の高精度な 測定が必要

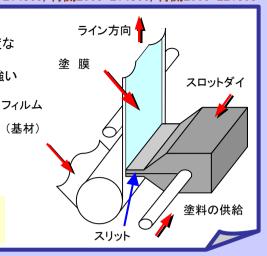
・加工機上でも使える技術にするため、高速で外乱振動や運動誤差に強い ことが要求される

#### 従来の方法

- ・離散的な測定、30点/1mを20分で測定
- 測定者により値かわる
- ゲージの幅(15mm)内部の幅が不明

スロットダイ加工後にスリット幅を、

迅速、高精度、定量的に測定できる測定法の研究を行う



#### 測定原理

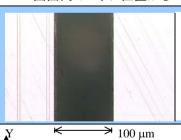
CCDカメラを走査して、 非接触、連続的に スリット幅を求める



光学系に傾斜がつくことによる輝度変化の影響、 ワーク表面の反射率による輝度変化の影響を除去

エッジ位置検出(2値化、▽ 2Gなどを選択)

1画面内のエッジ位置からスリット幅の計算





#### 走査時の運動誤差

X方向・・・ 両エッジを 見ることで相殺

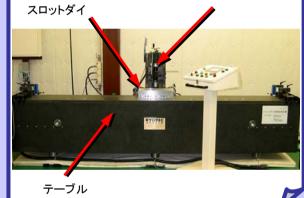
Z方向・・・Z方向運動誤差の 影響が小さくなる2値化閾値を 用いる

1µm/div Threshold = 127 Threshold = 145 Position in the Z direction µm

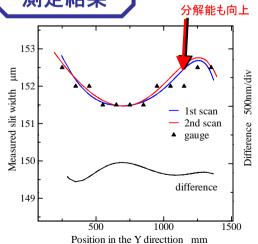
運動誤差によらずに 測定できる

# 測定装置

CCD カメラ



## 測定結果



- → 連続的な測定
- → 1000点/1mを30秒で測定
- → 定量的で、測定時間も大幅に短縮
- → 従来より細かなスリット幅変化を測定
- → 加工機上でも測定可能

Nanosystem Eng. Lab. & RYOTEC CORPORATION